

## О ЛЮКС-ВОЛЬТОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ ФОТОЭДС В СИСТЕМЕ Si—SiO<sub>2</sub>

С. А. ЗАЙДМАН, Н. К. КУРЫНДИНА, Д. И. СВИРЯКИН

(Представлена научным семинаром НИИ ЭИ)

Одной из возможностей использования метода конденсаторной фотоЭДС при исследовании характеристик поверхности является определение поверхностного потенциала по насыщению люкс-вольтовых характеристик [1, 2, 3]. При этом отсутствие токовых контактов, необходимых при исследовании поверхности методом эффекта поля, отсутствие металлического электрода на поверхности диэлектрика, необходимого в методе С—V характеристик, возможность использования образцов с широким диапазоном изменения удельного сопротивления свидетельствуют о перспективности метода при исследовании поверхности полупроводников в системе полупроводник — диэлектрик.

Целью настоящей работы было оценить эффективность метода определения поверхностного потенциала  $U_{so}$  по насыщению люкс-вольтовых характеристик при исследовании системы полупроводник — диэлектрик Si—SiO<sub>2</sub>, где пленка SiO<sub>2</sub> получалась путем термического окисления в цикле сухой — влажный — сухой кислород.

Для этой системы мы наблюдали насыщение люкс-вольтовой характеристики конденсаторной фотоЭДС  $\Delta U_\phi$ , что позволило определить  $U_{so}$ . Кроме того, определяя  $U_{so}$  методом эффекта поля, мы могли сопоставить полученные результаты.

Уровень инъекции  $\left( \delta = \frac{\delta_p}{n_i} \right)$  определялся из измерения фотопроводимости, причем, мы могли не учитывать изменения  $\delta = (U_{so})$ , так как в условиях нашего эксперимента фотопроводимость очень слабо менялась в зависимости от  $U_{so}$ , в то время как для заметного изменения величины фотоЭДС необходимы значительные изменения в  $\delta$  (рис. 1, а).

Экспериментальные исследования  $\Delta U_\phi$  проводились в широком диапазоне значений  $\delta$ . Для сравнения с экспериментом были получены расчетные зависимости  $\Delta U_\phi = \Delta U_\phi(\delta)$ . Они находились путем графического решения уравнения:

$$\begin{aligned} 2q n_i L_i F(Y, \lambda, \delta) + q N_d (1 - f_i) - q N_a f_i &= \\ = 2q n_i L_i F_0(Y_0, \lambda) + q N_d (1 - f_{i0}) - q N_a f_{i0}, & \end{aligned} \quad (1)$$

которое получено из условия постоянства полного поверхностного заряда. В уравнении (1) использованы обозначения работы [1]. Рассчитанные этим методом люкс-вольтовые характеристики для  $Y_{so} = 22 \frac{kT}{q}$  в случае отсутствия и при наличии поверхностных состояний приведены на рис. 2. Как видно из рисунка, при отсутствии поверхностных состоя-

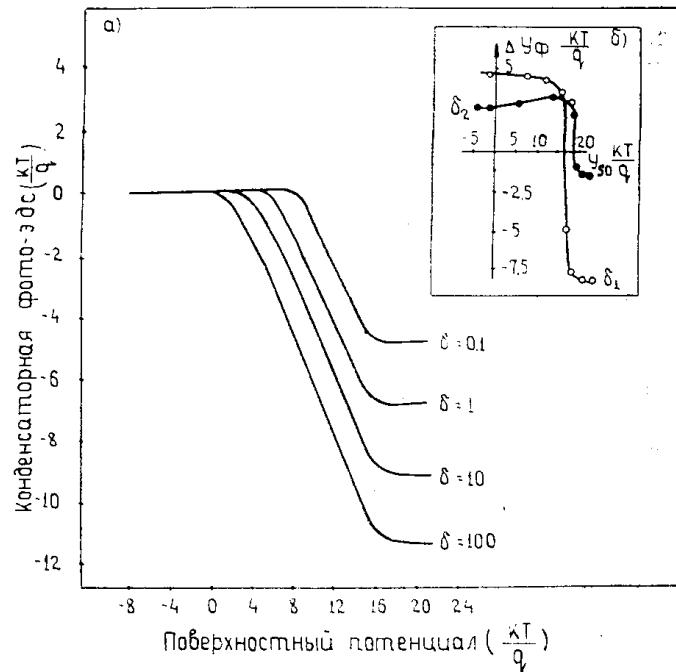


Рис. 1. Зависимость конденсаторной фотоэдс от поверхностного потенциала:  
 $a$  — расчетные зависимости при различных  $\delta$  без учета захвата неравновесных носителей на поверхностные состояния (для  $\lambda = \frac{P^0}{n_i} = 10^3$ );  
 $b$  — экспериментальные зависимости при  $\delta_1 > \delta$ ,

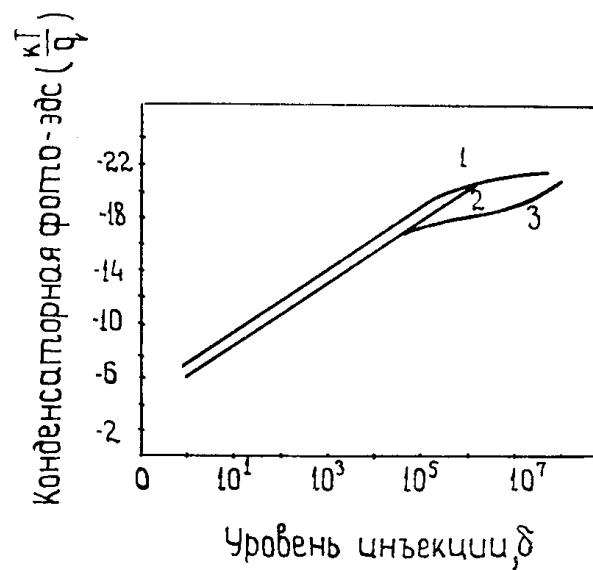


Рис. 2. Расчетные зависимости конденсаторной фотоэдс от уровня инъекции  $\delta$  для  $U_{s0}=22$  кТ/к;  $1 — N_t=0$ ;  $2 — N_t=10^{12}$  сост/см<sup>2</sup>·ср/сп =  $10^{-7}$ ,  $v=+4$  кТ;  
 $3 — N_t=10^{12}$  сост/см<sup>2</sup>·с<sub>p</sub>/с<sub>и</sub> =  $10^3$ ,  $v=4$  кТ

ний некоторая тенденция к насыщению наблюдается при очень больших уровнях инъекции ( $\delta > 3 \cdot 10^6$ ), причем предельное значение  $\Delta U_f$  равно значению равновесного поверхностного потенциала. Захват неравновесных носителей заряда поверхностными состояниями приводит к заниженному значению  $\Delta U_f$  и к увеличению уровня инъекции, при котором достигается насыщение  $\Delta U_f$ .

При экспериментальном исследовании системы Si—SiO<sub>2</sub> методом эффекта поля был определен равновесный поверхностный потенциал  $U_{s0}$ , значения которого для различных образцов менялись в пределах  $19 - 22 \frac{kT}{q}$ . На рис. 3 приведены экспериментальные люкс-вольтовые характеристики при различных потенциалах поверхности, соответствующих инверсии и обогащению. Из рисунка видно, что значения поверхности потенциала, определенные из насыщения экспериментальных кривых, значительно ниже его значений, полученных из эффекта поля. Так, для случая равновесного потенциала  $U_{s0} = 22 \frac{kT}{q}$  насыщение соответствует

значению  $8 \frac{kT}{q}$  (для других образцов оно не превышало  $11 \frac{kT}{q}$ ).

В работе [4] при исследовании зависимости конденсаторной фотоэдс от поверхностного потенциала при различных уровнях инъекции было установлено, что в формировании сигнала фотоэдс присутствует избыточный положительный сигнал диффузионного типа. Этот сигнал начинает превалировать в области потенциалов  $U_{s0} < 18 \frac{kT}{q}$  (рис. 1, б) и в этой же области потенциалов наблюдается более резко выражено насыщение люкс-вольтовых характеристик, включая область обогащения (рис. 3). Сопоставление экспериментальной зависимости с расчетной (рис. 2) позволяет заключить, что значительное занижение  $\Delta U_f$  обусловлено вкладом положительного избыточного сигнала и наличием захвата неравновесных носителей на поверхностные состояния.

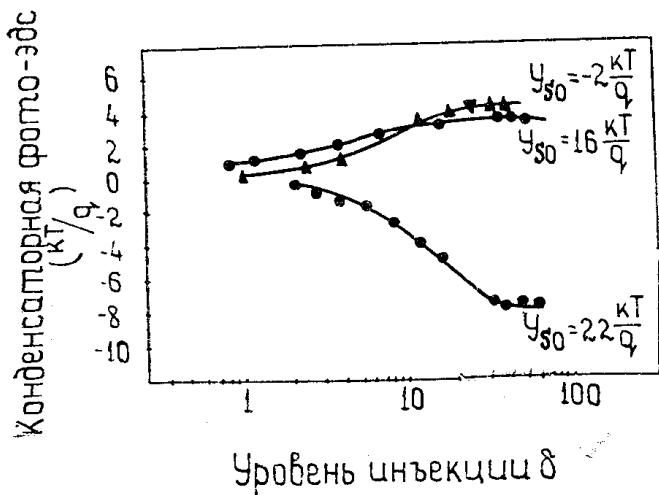


Рис. 3. Экспериментальные люкс-вольтовые зависимости при различных  $U_{s0}$ . Указаны значения  $U_{s0}$ , полученные по эффекту поля

На основании вышеизложенного можно сказать, что, по-видимому, метод определения поверхностного потенциала по насыщению люкс-вольтовой характеристики конденсаторной фотоэдс не является достаточно надежным и универсальным методом, поскольку захват неравновесных

носителей заряда на поверхностные состояния и вклад избыточной фотоЭДС оказывают весьма существенное влияние на вид этой характеристики.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. E. O. Johnson. Phys. Rev. 111, 153, 1958.
  2. I. Flinn. Surface Sciense 10, 32, 1968.
  3. Y. W. Lam, I. Phus. D. Appl. Phys. 4, 1370, 1971.
  4. С. А. Зайдман, Н. К. Курьинина, Д. И. Свиржкин. Некоторые особенности зависимости конденсаторной фотоЭДС от электрического поля в системе Si—SiO<sub>2</sub>. (Настоящий сборник).
-